⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-77630

filnt. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

④公開 平成2年(1990)3月16日

G 01 J 3/26 H 01 S 3/131 3/18 8707-2G 7630-5F 7377-5F

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全7頁)

69発明の名称

光干渉計及びそれを使用した半導体レーザの発振周波数安定化方法

②特 顧 昭63-228525

寛

20出 頭 昭63(1988) 9月14日

宛発明者 尾 中

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内

⑪出 顋 人 富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

四代 理 人 弁理士 松 本 昂

明報書

1. 発明の名称

光干沙計及びそれを使用した半導体レーザの発援周波数安定化方法

2. 特許請求の範囲

- (1) 温度変化に対する屈折率の変化の係数が負の値である光学媒質を用いて構成されることを特徴とする光干渉計。
- (2) 半導体レーザ(1)からの光を請求項 1 記載の 光干渉計(2)に入力し、

この光干渉計(2)で干渉して出力された光を受光器(3)で受光し、

上記半導体レーザ(1)の発振周波数が上記光干渉計(2)の干渉スペクトル(4)のピーク強度(5)又は所定強度(6)を与える周波数と一致するように制御することを特徴とする半導体レーザの発振周波数安定化方法。

3. 発明の詳細な説明

概 要

光FDM伝送方式に適した、光干渉計及びそれを使用した半導体レーザの発援周波数安定化方法に関し、

温度変化による干渉スペクトルの変化が著しくない光干渉計の提供を目的とし、

温度変化に対する屈折率の変化の係数が負の値である光学媒質を用いて光干渉計を構成する。

産業上の利用分野

本発明は、光FDM伝送方式に適した、光干渉計及びそれを使用した半導体レーザの発振周波数安定化方法に関する。

光ファイバを伝送路とする光通信又は光伝送の分野において、単一伝送路当たりの伝送容量を増大するためには、波長分割多重(WDM)伝送方式が有効である。近年、DFBレーザ等の狭線幅な単一縦モードスペクトルを有する半導体レーザ(LD)が開発されたことに伴い、高密度なWD

従来の技術

第7図は光FDM伝送方式の説明図である。光送信機81-a,b,c,…から出力された周波数がそれぞれf。f。,f。,…の出射光は、合成されて光伝送路82に送出される。光伝送路82により伝送された光FDM信号光は、光タップ83,84によって分岐されて複数の端末の光受信機85,86,…で受信される。

において、光伝送路101により伝送された光下 D M 信号光は、高精度な光分波器102によっな 光の段階でそれぞれの信号光に分離され、分離 れた信号光は、それぞれ受光素子103一 a 。 b 。 c 。 … 及び電気のは104ーa 。 b 。 c 。 … によって各電気的な信号成分に変換される。この方式はそのまま通常の強度変調方式に適用することが でき、光伝送路の経済的な構成が可能になる。光 分波器102としては、例えばマッハツェンダ干 渉針を用いてなるものが使用される。

上述した光FDM伝送方式を実現するためには、送信側で多数の光顔を所定の周波数位置に安定化することが必要となる。必要とされる周波数安定度は、周波数間隔の1%程度である。このため、周波数間隔が5GHz程度であるとすれば、光源を50MHz程度の制度で安定化する必要があり、光源を何らかの周波数基準に対して安定化する方法が用いられる。

第9回乃至第11回は、従来の周波数安定化方法を説明するための図である。LD111からの

第8図は一般的な光受信機の構成例説明図であ って、個はコヒーレント光通信方式におけるヘテ ロダイン又はホモダイン検波方式、(b)は通常の直 接検波方式を示すものである。(8)において光伝送 路91により伝送された光FDM信号光及び局部 発振光源92からの局部発振光は、混合器93で 混合されてフォトダイオード等の光検波器 9 4 に 入射される。このとき、各光FDM信号光の信号 成分は、光検波器94の二乗特性によって各信号 光の周波数と局部発振光の周波数との差の周波数 (例えば数 G lbc) の中間周波信号 (ヘテロダイン 検波の場合)として取り出されるから、局部発振 光の周波数を変化させてチューニングすることに よって、帯域フィルタ95においてそれぞれの多 重信号成分に分離することができる。この方式に よれば、受信感度の向上を期待できるので、光伝 送路における中継間隔の拡大もしくは中継器数の 削減又は分岐数の増大が可能となるばかりでなく、 高密度な周波数多重が期待できるので、光伝送路 を経済的に構成することが可能となる。一方、(b)

光は、光干渉計112を介して受光器113により受光に、 のののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 のののでは、 ののでは、 のののでは、 ののでは、 の

<u>発明が解決しようとする</u>課題

第10図に示されるファブリベロ干渉計の光学 葉質の屈折率を n 、 共振器長を l 、 光速を c とす ると、 共振ピークの 周波数軸上での間隔 (フリー スペクトルレンジ) FSRは、 $FSR=c/2n\ell$

で表され、共振器長がd l 変化したときの共振周波数の変化 Δ f は、光の波長を l。とすると、

△「=(dℓ/λ。/2n)FSRとなり、共振器長が入。/2n変化すると、FSRに相当する周波数変化(例えばℓ=10㎜,n=1.5のときに、FSR=10 GH2) が生じる。このためファブリペロ干渉計に多少なりとも温度変化が与えられると、共振光路長が変化し、干渉スペクトルが周波数軸上で著しくすれ、つまり、共振周波数が著しく変化し、LDの発振周波数を一定周波数に安定化することが困難になるという問題を生ずる。

そこで、本発明は、温度変化による干渉スペクトルの変化が著しくない光干渉計の提供を目的と している。

又、この光干渉計を使用してLDの発振周波数を安定化することを目的としている。

作用

光干渉計における光学媒質の屈折率をn、光路 長 (例えば共振器長)を l とするときに、温度 (T)の変化に対する共振光の波長 l。 又は周波 数 v の変化の割合は、

 $\frac{1}{\lambda_o}$ $\frac{d\lambda_o}{dT} = -\frac{1}{\nu}$ $\frac{d\nu}{dT} = \frac{1}{n}$ $\frac{\partial n}{\partial T} + \frac{1}{\ell}$ $\frac{\partial \ell}{\partial T}$ のように表される。光学媒質の線熱膨張係数に相当する $\partial \ell / \partial T$ は一般に正の値を有するから、温度変化に対する屈折率の変化の係数 $\partial n / \partial T$ を相殺して、光干渉計の光路長変化を抑制することができ、その結果、温度変化に対して安定な光干渉計を提供することができる。

このように本発明の光干渉計では、温度変化による干渉スペクトルの周波数軸上でのずれが小さいから、第1図に示すようにLDの発援周波数を干渉スペクトルに対して安定化することによって、高い発援周波数の安定度を得ることができる。

尚、第1図に示される発援周波数安定化方法に

課題を解決するための手段

光干渉計の光学媒質として使用する光学がラスのなかには、その組成によって温度変化にができる。 国折率の変化の係数を負の値とすることができるものがあり、このような光学媒質を用いて光である。 計を構成することによって、一般に正の値である線熱膨張係数による一定に保つことができる。 に対して安定な周波数基準として使用することができる。

この光干渉計を使用してLDの発援周波数を安定化する場合には、第1図(a)に示すように、LD1からの光を光干渉計2に入力し、この光干渉計2で干渉して出力された光を受光器3で受光しておき、同図(ロに示すように、LD1の発援周波数が光干渉計2の干渉スペクトル4のピーク強度5又は所定強度6を与える周波数と一致するように制御する。

おいて、しDの発援周波数が干渉スペクトルのピーク強度又は所定強度を与える周波数と一致波を与える周波数と一切強度を与える周波数に一切強度を与える周波数に一致するように制御する方法を想定しているからであり、これについては実施例で詳しく説明する。

実 施 例

以下本発明の実施例を図面に基づいて説明する。 第2図は、本発明の実施例を説明するたた図である。 ファブリペロ干渉計の具体的構成例を示す計算である。 同図(a)に示されるパルク型のでおける。 光ファイバ11から出射された光をレンメート光と より概略コリメート光とし、このコリメート反射 より概略コリメート 光としての は さ れ た 反射 エ と そ の る 光 共 扱 器 に 透 過 さ せ て て 又 は びレンズ 1 6 に よ り 集 東 して 光 ファイバ 1 7 いる。 図示しない 受 光 衆 子 に 入 射 さ せ る よ う に 光学媒質13としては、例えばHOYA社製のかラスADC1を使用することができる。この範囲において109×10~であり、温度変化に対対のが一20セ~+20セ~+60セののではおいてー6.6×10~6/セマー8.5×10~6/セであるのではいけらに伴変化に対することができるのでは、上述したものの他に、同社製ド、5、FC5、FSK10、FCD10等がある。

第2図(b)に示される導波路型の干渉計では、 導波路を構成している低屈折率部21及び高屈折 率部22を上述のような光学媒質から形成し、高 屈折率部22の両端面に適当な反射膜23,24 を設けている。

第2図(c)に示されるファイバ型の光干渉計

では、コア 3 1 及びクラッド 3 2 からなる所定民さの光ファイバを上述したような光学媒質から 水 成し、その両端面に反射膜 3 3 、3 4 を設け、スプライシング等の技術により光伝送路としての光ファイバ 3 5 、3 6 と接続している。これら導波路型又はファイバ型の光干渉計にあっても、バルク型と同様に温度変化に対する干渉スペクトルの周波数軸上でのずれを防止することができる。

てPID制御回路50によりLD42の駆動電流がフィードバック制御される。

第4 図は、除算器の出力 V。 とし D 4 2 の発振周波数との関係を示すグラフである。この干渉スペクトルは、上述したファブリペロ光干渉計の構成により極めて再現性良く得ることができるから、スペクトルピークの肩Pに発振周波数を安定化すべく基準電源 4 9 の電圧出力 V。 を設定することにより、し D 4 2 の発振周波数を V。 に対応したf。 に安定化することができる。

 て発援器 6 3 からの分岐出力により同期検波され、その検波出力に基づいた P I D 制御回路 6 7 の動作により、駆動回路 6 1 がフィードバック制御されるようになっている。

第6図において、71で示されるのは、ファブリペロ干渉計64の干渉スペクトルであり、72で示されるのはその一次微分曲線、即ちロックインアンプ66の出力特性である。このように、LDを周波数変額するとともにこれにともなう受光レベルの変化を同期検波することにより、一次微分曲線72のリニアな部分を用いて周波数を行うことができる。

上述した光学媒質を用いてファブリベロ干渉計を構成することで、第3図乃至第6図に示される 実施例において従来と同様の温度制御を行ったと きに、LDの発援周波数の安定度を一桁以上高め ることができた。

ところで、第2回に示されるようなファブリベロ干渉計を実際に使用する場合、これらの干渉計

以上の実施例においては、特にしDの発振周波 数安定化装置におけるファブリベロ干渉計につい で説明したが、同装置におけるリング干渉計につ いても本発明は有効である。又、本発明をマッハ ツェンダ型光干渉計に適用することによって、例 えば第8図(従来例図)に示される光合分波器1 02の通過帯域特性を温度変化に対して極めて安 定なものとすることができる。

発明の効果

以上詳述したように、本発明によれば、温度変化による干渉スペクトルの変化が著しくない光干渉計を提供することが可能になるという効果を奏する。又、この光干渉計を使用してLDの発振周波数を安定化する場合には、高い周波数安定度を

得ることが可能になるという効果もある。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の原理図、

第2図は本発明の実施例図であって、ファブリベロ干渉計の具体的構成例を示す図、

第3図は本発明の実施例を示すしDの発振周波数安定化装置のブロック図、

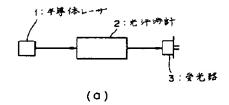
第4図は第3図に示される装置の動作説明図、 第5図は本発明の他の実施例を示すしDの発振 周波数安定化装置のブロック図、

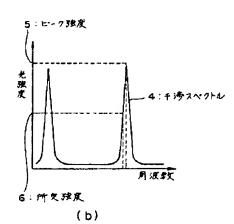
第6図は第5図に示される装置の動作説明図、 第7図乃至第11図は従来技術を説明するため の図である。

42.62…LD(半導体レーザ)、
2…光干渉計、

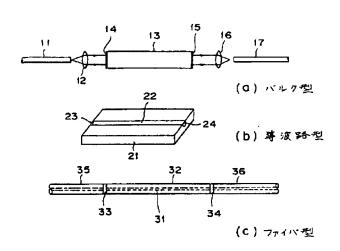
3. 44, 46. 65… 受光器、

45.64…ファブリペロ干渉計。

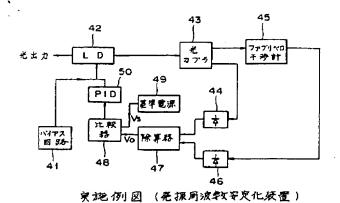




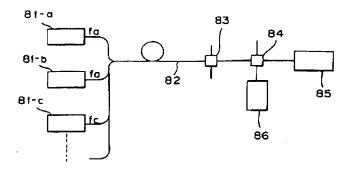
本発明の原理図 第 1 図

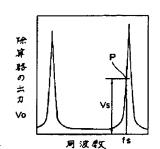


実施例図 (光干涉計) 第 2 図



 \mathbf{z}



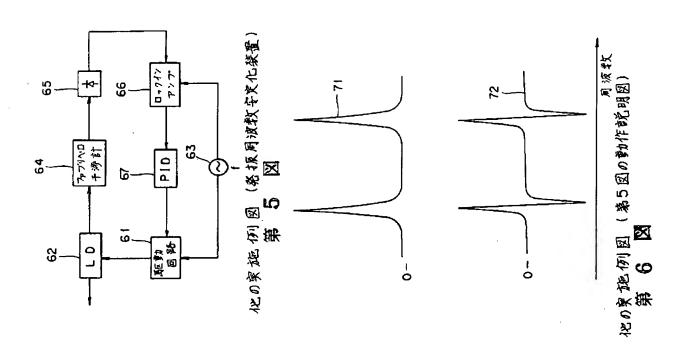


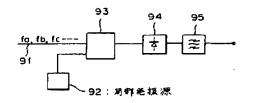
第 3

81-a, b, c: 光送信機 85, 86: 光受信機

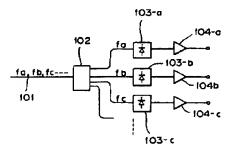
従来例図 第**7** 図

実施例図(第3図の動作説明図) 第 4 図





(ロ) ヘテロダインタはホモダイン検波方式



(b) 直接検波方式

憷来例図 第8図

